

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于董事、副总经理辞职暨核心技术人员调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 董事辞任：盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事HAIPING DUN、STEPHEN SUN-HAI CHIAO、罗千里因个人原因申请辞去公司董事职务及董事会相关委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。

● 副总经理辞任：公司副总经理SOTHEARA CHEAV因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

● 核心技术人员调整：因公司董事长HUI WANG工作职责调整，公司不再认定其为公司核心技术人员；因副总经理SOTHEARA CHEAV离任，公司不再认定其为公司核心技术人员。

● 影响说明：上述人员变动不会对公司董事会及管理层的正常运作、技术研发、核心竞争力产生重大不利影响。

一、部分董事、高级管理人员辞职情况说明

公司董事会近日收到董事HAIPING DUN、STEPHEN SUN-HAI CHIAO、罗千里以及公司副总经理SOTHEARA CHEAV的书面辞职报告。具体情况如下：

1、HAIPING DUN因个人原因申请辞去公司董事职务、董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后HAIPING DUN将不再担任公司任何职务；

2、STEPHEN SUN-HAI CHIAO因个人原因申请辞去公司董事职务、董事会战略委员会委员职务，辞职后STEPHEN SUN-HAI CHIAO将不再担任公司任何职务；

3、罗千里因个人原因申请辞去公司董事职务、董事会提名委员会委员职务，辞职后罗千里将不再担任公司任何职务；

4、副总经理SOTHEARA CHEAV因已过退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，

辞职后SOTHEARA CHEAV不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。董事HAIPING DUN、STEPHEN SUN-HAI CHIAO、罗千里的辞职未导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。上述人员确认，与公司、董事会、监事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。

截至本公告披露日，上述人员持有公司股份情况如下：

姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
HAIPING DUN	69,230	0.02
STEPHEN SUN-HAI CHIAO	69,230	0.02
罗千里	69,230	0.02
SOTHEARA CHEAV	260,000	0.06

上述人员所持公司股份在辞职后仍将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定。

二、核心技术人员调整的具体情况

（一）核心技术人员具体情况

HUI WANG，男，1961年11月出生，美国国籍，拥有中国永久居留权，精密工程专业博士，上海市“浦江人才计划”获得者。1994年2月至1997年11月，担任美国Quester Technology Inc. 研发部经理。1998年5月至今任ACMR董事长兼首席执行官。2005年5月至今任公司董事长。

SOTHEARA CHEAV，男，1952年3月出生，美国国籍，无其他国家永久居留权，电子技术专业学士。2007年3月加入公司，历任制造部经理、制造部总监，2015年1月至2025年3月任公司副总经理。

（二）调整原因

1、因公司董事长HUI WANG工作职责有所调整，公司不再认定其为公司核心技术人员；

2、因公司副总经理SOTHEARA CHEAV达到法定退休年龄并辞去公司职务，公司不再认定其为公司核心技术人员。

（三）保密及知识产权情况

公司与上述相关人员均签订了《保密及知识产权保护协议》和《竞业限制协议》，约定其在职期间及离职后均需对公司技术秘密和商业秘密履行保密义务，不得以任何方式泄露、转让或使第三方知悉。截至本公告披露日，公司未发现上述人员存在违反保密协议的情形。

（四）参与的研发及专利情况

HUI WANG及SOTHEARA CHEAV在职期间参与的研发成果均为职务成果，其知识产权所有权归公司所有，不存在涉及职务成果或知识产权的纠纷或潜在纠纷。本次调整不会影响公司知识产权的完整性。

三、核心技术人员调整对公司的影响

公司作为半导体设备行业的领先企业，始终高度重视技术创新和人才培养，建立了完善的研发体系和人才梯队，有效保障了公司技术研发的持续性和稳定性。截至2022年末、2023年末、2024年末，公司研发人员数量分别为519人、733人及931人，占当期员工总人数比例分别为43.29%、46.45%、46.50%，公司研发人员数量整体呈增长趋势。本次核心技术人员的调整属于公司正常的人员结构优化，公司现有研发团队及核心技术人员能够充分支持未来核心技术的持续研发和创新，不存在对特定技术人员的重大依赖。

本次调整前后公司核心技术人员名单如下：

时间	核心技术人员姓名
本次调整前	HUI WANG、王坚、陈福平、SOTHEARA CHEAV、王俊、李学军
本次调整后	王坚、陈福平、王俊、李学军

四、公司采取的措施

前述人员已承诺按照公司规定完成工作交接，公司将确保其负责的工作平稳过渡。公司董事长HUI WANG仍将继续担任公司董事长职务，持续领导公司战略发展，为公司的稳健经营和长远规划提供指导。公司将根据业务需要，及时调整相

关工作安排，确保各项工作的顺利开展。同时，公司将继续加大研发投入，强化人才队伍建设，引进和培养优秀技术人才，以加强技术创新能力并持续提升核心竞争力。

五、致谢

公司董事HAIPING DUN、STEPHEN SUN-HAI CHIAO、罗千里在职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和发展做出了积极贡献，公司及董事会谨向其表示衷心感谢。

公司副总经理SOTHEARA CHEAV在担任高级管理人员及核心技术人员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的技术进步和发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心感谢。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2025年3月12日